文部科学省委託事業【マテリアル先端リサーチインフラ】

※当拠点で記入

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点

令和6年度 支援利用申請書【学外・解析プラットフォーム用】

令和　　年　　月　　日

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点長　殿

支援利用申請者

氏　　名：

フリガナ：

職　　名：

所　　属：

所 在 地：〒

TEL　 ：

E-mail ：

年齢区分：年齢層ご選択

指導教員（申請者が学生／院生の場合）

氏　　名：

フリガナ：

学　　年：

所　　属：

下記のとおりマテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点を利用したいので申請します。

なお利用許可後は利用規程・課金規程を遵守します。

記

1. 申請課題名（新規･継続･発展）

和文：

　　Eng.:

1. 支援利用での希望

支援利用による成果：公開（[成果公開事業](https://nanoplatform.osaka-u.ac.jp/facilityuse.html" \l "spb-bookmark-1)）

（超高圧電子顕微鏡センターの本事業の研究支援は成果公開にご協力いただきます）

1. データ提供の意思確認

[データ提供](http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/nanoplatform-kouzoukaiseki/dl/20240307-data_teikyo.pdf)：する　　しない

1. 希望する支援利用形態（申請時は複数選択可）
2. 機器利用
3. 技術代行
4. 技術補助
5. 共同研究
6. 技術相談
7. データ利用
8. 利用の期間（年度内）

　　　令和　　年　　月　　日　～　令和　7年　3月31日

1. 利用したい装置【ARIM 微細構造解析プラットフォーム支援提供装置】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ✔印 | ARIM  装置番号 | 設備（設備群）名 | メーカー・機種 |
|  | OS-001 | 3MV 超高圧電子顕微鏡 | （株）日立製作所 “ H-3000” |
|  | OS-002 | 1MV 物質・生命科学超高圧電子顕微鏡 | 日本電子（株） “JEM-1000EES” |
|  | OS-003 | 200kV 原子分解能走査透過分析電子顕微鏡 | 日本電子（株） “JEM-ARM200F” |
|  | OS-004 | 300kV クライオ電子顕微鏡 | サーモフィッシャーサイエンティフィック“Titan Krios” |
|  | OS-005 | 複合ビーム３次元加工・観察装置 | サーモフィッシャーサイエンティフィック“Scios2” |
|  | OS-006 | 高分子・生物系電子顕微鏡用試料作製装置群 | ライカマイクロシステムズ “UC7” |
|  | OS-007 | 材料系電子顕微鏡用試料作製装置群 | アメテック株式会社 “PIPS II” |
|  | OS-008 | 電界放出型 200kV 高分解能電子顕微鏡 | 日立ハイテク “HF-2000” |
|  | OS-009 | 200kV 回折コントラスト電子顕微鏡 | 日立ハイテク “H-800” |
|  | OS-011 | 120kV マルチマテリアル用電顕 | 日本電子（株） “JEM-1400” |

提出後の利用したい装置の追加は可能です

1. 本申請課題に関連した助成金・競争的資金

　資金名および課題名（該当なき場合は「なし」と記入）

資金名：

（例：「科研費（基盤 A）」、「（公財）○○振興会 スタートアップ研究助成」、「A-STEP ○○育成事業」）

課題名（任意）：

（利用負担金の実際の支払い財源の問い合わせではありません。助成金や競争的資金の申請課題を実施するにあたり、研究・開発計画の一部について当拠点を利用して進める場合にご記入ください。）

1. 当拠点を利用するきっかけ（任意記入)

（記入例:「○○学会の付属展示会ブースでパンフレットをもらった」、「マテリアル先端リサーチインフラ

ウェブサイト(ARIM Japan)の共用設備検索に利用したい装置があった」など）

**申請上の注意点**

本申請書の提出時には、必ず上長・指導教官等契約権限を委任された方の承諾を得てください。

当拠点への本申請書の提出をもって、拠点利用規程(ARIM微細構造解析プラットフォーム）を

遵守の上で当拠点を利用することおよび当拠点から支援を受けることに同意したことになります。

秘密保持契約等別途合意文書が必要な場合は拠点までご相談ください。